



Environmental Test Solutions

鐳射全息干涉儀

Laser Holographic Interferometer



Specifications

- 雷射器 He-Ne LASER
- 分光鏡
- 反射鏡
- 全息干板
- 擴束鏡
- 待測物

全息干涉法是利用全息照相技術進行干涉計量的方法，它是一種非接觸式高精度的全場測量方法。在實驗應力分析中，全息干涉法可以用於位移測量和振動分析，利用透射全息技術可以分析透明雙折射材料模型中的應力，應用脈衝全息可以解決瞬態問題。

全息干涉用於位移測量時，常採用雙曝光法（兩次曝光法），即在物體變形前後兩次曝光拍攝全息圖。再現時，則有物體變形前後的兩束物光波，由於他們的光程不同，故發生干涉，形成與位移或變形有關的干涉條紋圖。

全息干涉法不但適用於不同材料，形狀，表面狀況的物體。在多種受載荷條件和特殊工作環境下的力學測量。而且，在固體力學方面，全息干涉法用於靜，動態位移或形變場的測量，應變分析，振動分析，斷裂力學及生物醫學研究等方面。

